

# 表裏3次元測定システム TOMOS 100H

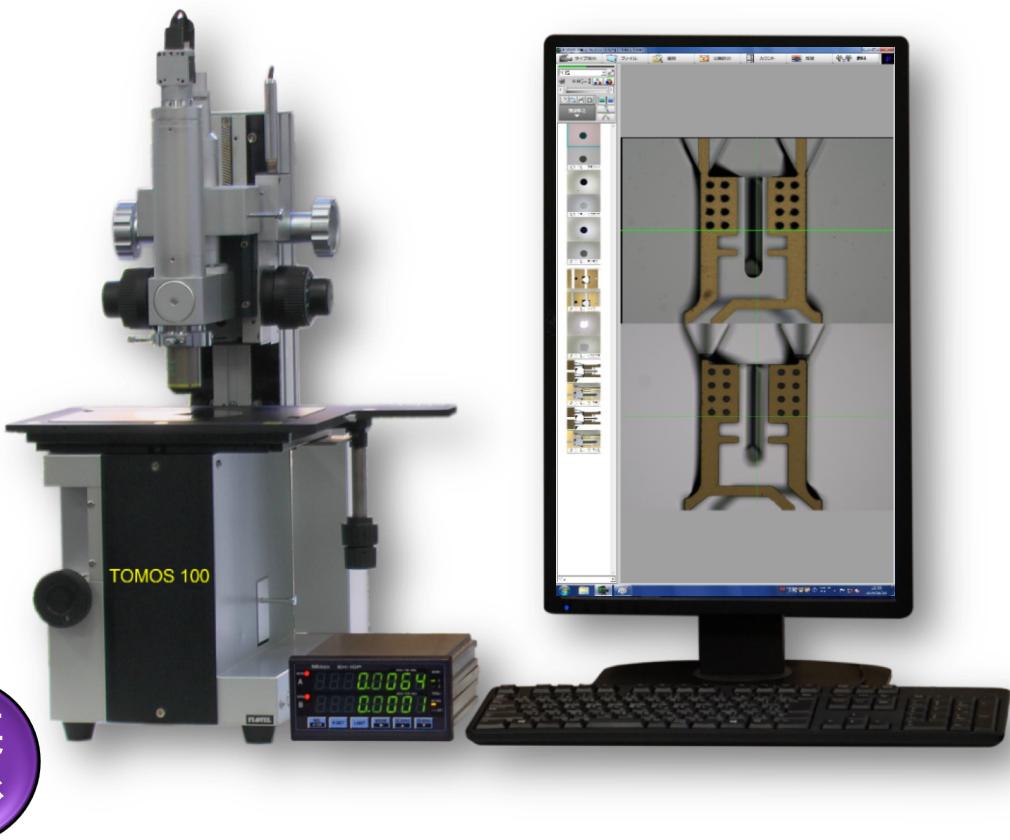
厚さ  
測定

段差  
測定

表裏  
座標

形状  
計測

表裏  
撮影

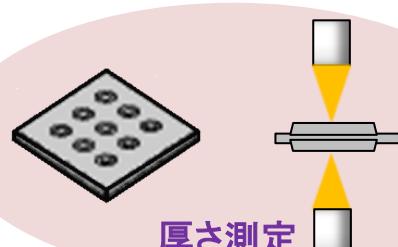


表裏顕微鏡で射影パターン照明によりMEMS等の電子部品の段差や厚みが精密に測定できます。

表裏の座標、形状を、 $\pm 1\mu\text{m}$ の精度で測定できます。



段差測定



厚さ測定

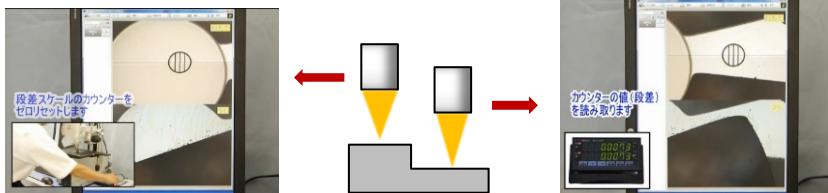
## ●射影パターン照明

試料に射影パターン照明でピント位置調整



## ●段差測定

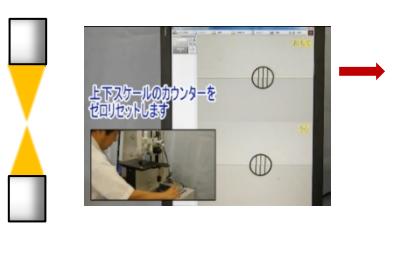
段差のある試料の2点にそれぞれ射影パターンを合わせ、その差をスケールで読み取る



## ●厚み測定

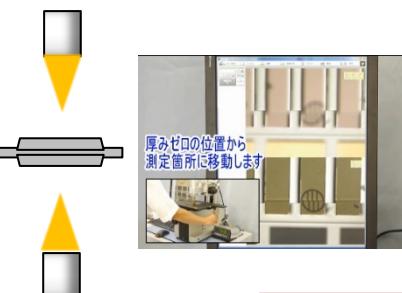
### ① ゼロ点校正

試料無しで表裏射影パターンでピントを合わせ、絶対厚みゼロポイント位置設定



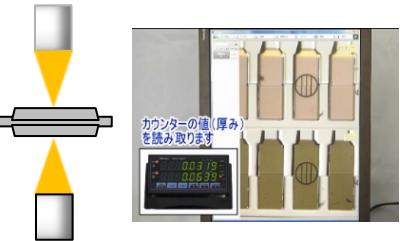
### ② 試料設置

対物レンズ間を広げて測定試料をステージに設置する



### ③ 厚み測定

試料の表裏それぞれに射影パターンを合わせ、その差をスケールで読み取る

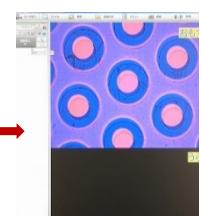


## ●表裏座標、形状測定

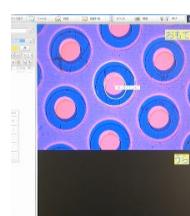
### 表裏撮影



### 表裏映像重畳

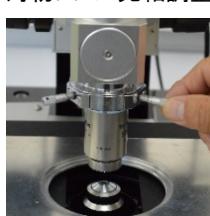


### ずれ量測定

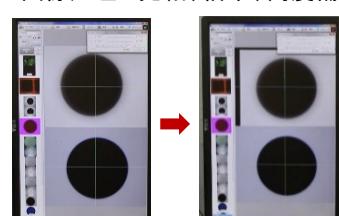


## ●表裏顕微鏡の光軸、倍率、角度を補正

### 対物レンズ光軸調整



### 画像処理で光軸、倍率、角度補正



## ●主な仕様

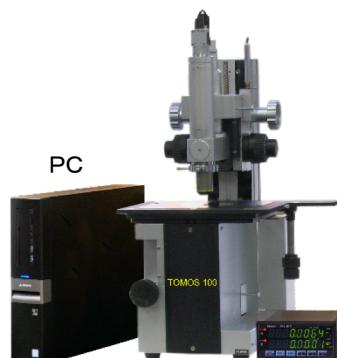
### 光学系

- ・ 鏡筒 : 2 (正立、倒立)
- ・ 対物レンズ : 2 (10倍)
- ・ 射影パターン : 2種類
- ・ 粗微動調整 : 手動 (正立、倒立)
- ・ 照明 : 可変 (正立、倒立)
- ・ カメラ : 2 (正立、倒立)
- ・ スケール : 2 分解能  $\pm 1\mu\text{m}$

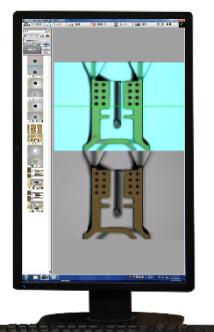
### 制御部

- ・ PC-OS : Windows10
- ・ 表示モニター : 2 画面表示
- ・ 計測機能 測定 : 画像ファイリング、座標位置ずれ測定  
段差測定、厚み測定

### 表裏顕微鏡



### 2画面表示モニター



### スケールカウンター

## ■お問合せ

**ARVIS® アルビス株式会社**

〒182-0026 東京都調布市小島町1-1-1

UECアライアンスセンター301

株式会社フローベル社内 アルビスショールーム

TEL : 080-4123-7842 (営業部)

Web : <http://www.arvis-co.jp/microeye/seit.html>

E-mail : [support@arvis-co.jp](mailto:support@arvis-co.jp)

**FLOVEL 株式会社 フローベル**

〒150-0003 東京都渋谷区恵比寿3-1-7 タマビル恵比寿3階

TEL : 03-5475-5180 FAX : 03-5475-5181